



△				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	-	CHAMFER 一般面取	-	QUANTITY 個数	
△				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	-	FINISHING 仕上	-	-	
△						TREATMENT CONTACT 処理接点	-	DECENTRATION 偏芯	-		
△				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)	
△				Y. S.	S. K.	OVER 63 UP TO 250	±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15	UNIT (mm)	-	VS - FR 32	
△	14. 02. 03	1	ロケット固定位置変更 ※対策			OVER 16 UP TO 63	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1				SCALE
	DATE	EXCH NO.	REVISION 変更記事			TOLERANCES	A B C S	DATE	14. 02. 03	DRAW NO.	0121A2